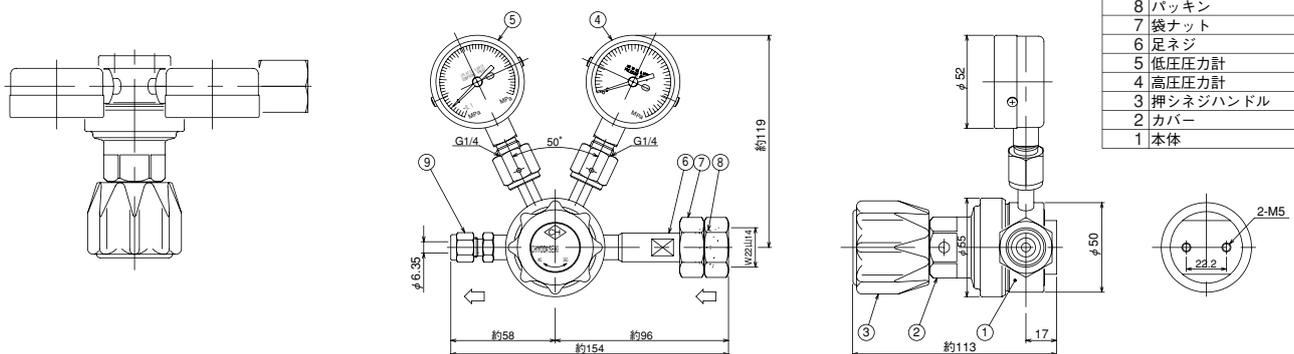


① ボンベ用 (MAX.1次圧力:3.0MPa, 調整圧力:0.1~0.3MPa) アンモニア, 塩素, 硫化水素, 亜硫酸ガス等

EX-20mkII-F/EX-100mkII-F…本体溶接構造

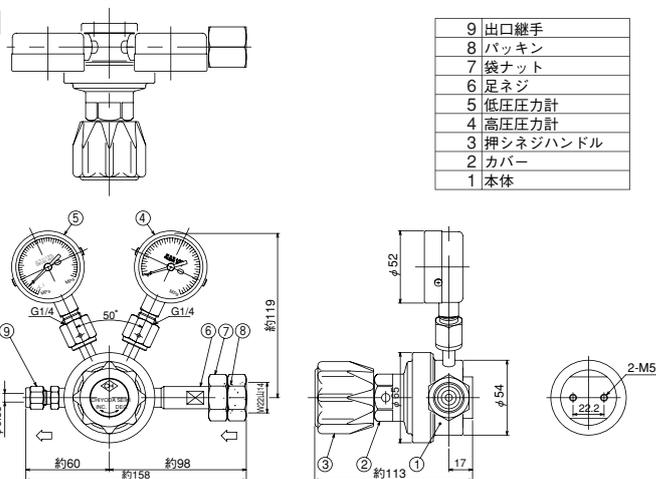
【外観寸法図】



- 9 出口継手
- 8 パッキン
- 7 袋ナット
- 6 足ネジ
- 5 低圧圧力計
- 4 高圧圧力計
- 3 押しネジハンドル
- 2 カバー
- 1 本体

EX-20mkII-F

【外観寸法図】



- 9 出口継手
- 8 パッキン
- 7 袋ナット
- 6 足ネジ
- 5 低圧圧力計
- 4 高圧圧力計
- 3 押しネジハンドル
- 2 カバー
- 1 本体

EX-100mkII-F

【主なガスの物理的性質】

| ガス名 | 化学式 | 分子量 | 沸点 latm, °C | 密度 | | 特性 | | | |
|-------|------------------|-------|----------------|--------|--------|-----------|------------|---|---|
| | | | | ガス g/l | 液 g/ml | 不 | 燃 | 毒 | 支 |
| アンモニア | NH ₃ | 17.03 | -33.35 | 0.890 | 0.674 | | ● | ● | |
| 硫化水素 | H ₂ S | 34.08 | -60.2 | 1.539 | 0.993 | | ● | ● | |
| 塩素 | Cl ₂ | 70.91 | -34.0 | 3.214 | 1.468 | | | ● | |
| 亜硫酸ガス | SO ₂ | 64.06 | -10.0 | 2.927 | 1.46 | ● | | ● | |
| ガス名 | 蒸気圧 | | | | | 爆発限界 % | 怒限量 ppm | | |
| | -20°C | -10°C | 0°C | 30°C | 単位 | | | | |
| アンモニア | 1.88 | 2.87 | 4.24 | 11.5 | atm | 15~28 | 50 | | |
| 硫化水素 | 5.39 | 7.53 | 10.2 | 22.6 | atm | 4.3~45 | 10 | | |
| 塩素 | 1.6 | 2.4 | 3.5 | 8.9 | atm | — | 1 | | |
| 亜硫酸ガス | 0.63 | 1.00 | 1.53 | 4.50 | atm | — | 5 | | |

【標準仕様】

| 仕様 | 型式 | ボンベ用 1段減圧式 | |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | EX-20mkII-F | EX-100mkII-F |
| 適用ガス | | アンモニア (NH ₃)、硫化水素 (H ₂ S)、塩素 (Cl ₂)、亜硫酸ガス (SO ₂) 等 | |
| 材質 | 本体 | SUS316 | |
| | ダイヤフラムシート | SUS316 | |
| 1次圧力 | | 3.0MPa以下 | |
| 調整圧力 | | 0.1~0.3MPa | |
| 標準流量 | NH ₃ | 45 ℓ/min | 129 ℓ/min |
| | H ₂ S | 32 ℓ/min | 91 ℓ/min |
| | Cl ₂ | 22 ℓ/min | 63 ℓ/min |
| | SO ₂ | 23 ℓ/min | 66 ℓ/min |
| 1次圧力計 | | 0~4.0MPa | |
| 2次圧力計 | | -0.1~0.6MPa | |
| 使用温度 | | -10~+60°C *条件により発生量や温度低下による凍結などで、限界流量が異なりますので注意して下さい。 | |
| 入口接続 | | NH ₃ ; W22山14 (左)袋ナット H ₂ S, Cl ₂ , SO ₂ ; W26山14 (左)袋ナット | |
| 出口接続 | | 1/4スウェジロック本体溶接 ※ダイヤフラム弁付は、オプション | |
| 本体出入口接続 | | R1/4差込溶接構造 | |
| C値 | V | 0.05 | 0.05 |
| 質量 | | 1.2kg | 1.3kg |

I 一般工業ガス用 圧力調整器

II 分析用標準ガス、理科実験用 圧力調整器

III 半導体用特殊材料ガス、高純度・超高純度 キャリアガス用圧力調整器

IV 一般工業ガス 供給設備・機器

V 分析用標準ガス 供給設備・機器

VI 半導体用特殊材料ガス、高純度・超高純度 キャリアガス供給設備・機器

VII 大臣認定について

VIII 高圧ガス法

IX 参考資料